

受託試験料金表
産学官金連携機構 設備共用部門の設備

(2020年7月)

受託試験料金は、装置使用料×装置使用時間＋技術料×技術時間(＋オプション料＋指導料) で計算されます。
装置使用時間は装置が稼働している時間、技術時間は試料調製・測定(放置測定を除く)・解析等の時間です。
オプション料は特別に測定で必要となる消耗品の実費です。
試験結果をもとにした改善案の提案等の指導には、26,000円/時間の指導料がかかります。
高等専門学校・国公立/私立大学については下記の5割の料金です。
料金はすべて消費税を含んだ金額です。
ご依頼方法は <https://kiki.web.nitech.ac.jp/gakugai/> から御覧ください。

測定室名	装置名、型式	性能・機能	受託試験料金(税込) (表示の他にオプション有)
物理・表面計測系			
透過型電子顕微鏡室Ⅰ	FE-TEM, JEM-2100Plus	加速電圧:80～200 kV、STEM、EDS、ハイコントラスト仕様	装置使用料:20,592円/時間 技 術 料:8,580円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅱ	FE-TEM, JEM-2100F	加速電圧:200 kV、STEM、EDS、EELS	装置使用料:20,592円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	イオンスライサ EM-09100IS	傾斜角:最大±6° エッチングレート:5 μm/min (Si換算)	装置使用料:3,432円/時間 技 術 料:8,580円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅲ	3D-TEM, JEM-z2500	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 加速電圧:200 kV 格子像分解能:0.1 nm	装置使用料:25,168円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	局所熱分析装置 Nano-TA, VESTA	分解能(高)、測定範囲:>100 nm、150 μm x 150 μm 分解能(低)、測定範囲:>1.5 μm、12 mm x 8 mm 測定温度範囲:室温～400℃、プローブ径:<30 nm 転移温度マッピング、他	装置使用料:9,152円/時間 技 術 料:8,580円/時間 (但し、プローブは利用者負担)
	ウルトラミクロトーム Leica EM UC7, FC7	切削ウィンドウ:0.2-14 mm 切削スピード:0.05-100 mm/s 切片の厚さ:0-15000 nm	装置使用料:2,288円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	凍結試料作製装置 EM-19500 JFD II	真空度:5x10 ⁻⁵ Pa以下、温度制御:+40～-170℃ 試料傾斜角度:0～90°、蒸着材料:Pt-C、C	装置使用料:4,576円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	TEM, JEM-1400Plus	加速電圧:100 kV 格子像分解能:0.2 nm	装置使用料:2,288円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	真空蒸着装置 JEE-420T		装置使用料:2,288円/時間 技 術 料:8,580円/時間 (但し、蒸着源は利用者負担)
透過型電子顕微鏡室Ⅳ	TEM, JEM-2100	加速電圧:200 kV、分解能:0.23 nm	装置使用料:10,868円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	複合ビーム加工観察装置 JIB-4500	FIB部ーイオン源:Ga液体イオン源、ビーム電流:0.5～30000 pA SEM部:Lab6-フィラメント、像分解能:2.5 nm 特徴:SIM像とSEI像もしくはBEI像を同時に観察可能	装置使用料:6,292円/時間 技 術 料:8,580円/時間
透過型電子顕微鏡室Ⅴ	原子分解能分析電子顕微鏡 JEM-ARM200F	加速電圧:200 kV TEM、STEM、電子回折、エネルギーフィルター、EDS、EELS	ナノテクプラットフォーム事業のページから ご確認ください。 http://nano.web.nitech.ac.jp/
軟X線分光室	SXES, JXA-8230	波長分散型分光器(4CH)、軟X線分光器(1CH) エネルギー分散形X線元素分析装置	装置使用料:20,592円/時間 技 術 料:8,580円/時間
X線マイクロアナライザー室	FE-EPMA, JXA-8530F	波長分散型X線分光器(3CH) エネルギー分散形X線元素分析装置(2CH)	装置使用料:15,444円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	FE-SEM, JSM-7001F	エネルギー分散形X線元素分析装置付き 結晶方位解析システム	装置使用料:9,724円/時間 技 術 料:8,580円/時間
	SPM, JSPM-5200	分解能 水平:0.1 nm 垂直:0.01 nm	装置使用料:6,292円/時間 技 術 料:8,580円/時間
走査電子顕微鏡室Ⅱ	SEM, JSM-6510	二次電子分解能:3 nm (30 kV)、8 nm (3 kV) 内部起電力像測定用プローブシステム付き	装置使用料:3,432円/時間 技 術 料:8,580円/時間
走査電子顕微鏡室Ⅲ	L-FE-SEM, JSM-7800F	加速電圧:0.01～30 kV LED, UED (UEDフィルター電圧可変機能組込み) エネルギー分散形X線元素分析装置/カソードルミネセンス分析装置付き	装置使用料:21,164円/時間 技 術 料:8,580円/時間
X線分析室	XRD, SmartLab	X線源出力:9 kW、回転対陰極式	装置使用料:4,004円/時間
	XRD, SmartLab SE	X線源出力:3 kW、封入管式	技 術 料:8,580円/時間
オージェ分析室	AES, JAMP-9500F	二次電子分解能:3 nm (25 kV、10 pA) オージェ分析時最小プローブ径:8 nm (25 kV、1 pA) エネルギー分解能:0.05～0.6%	装置使用料:15,444円/時間 技 術 料:8,580円/時間
光電子分光室	XPS, PHI 5000	X線源:単色化された走査型(ターゲット:AL-Kα) 走査範囲:1 mm、最小ビーム径:10 μm エネルギーアナライザー:静電半球型	装置使用料:12,012円/時間 技 術 料:8,580円/時間
2次イオン質量分析室	TOF-SIMS, PHI TRIFTV nano TOF	質量分解能(無機材料):9,000M/Δμ以上 質量分解能(有機材料):9,000M/Δμ以上 (PET(m/z 104)にて)	装置使用料:22,308円/時間 技 術 料:8,580円/時間
電子顕微鏡試料作成室	FIB, JEM-9320FIB	加速電圧:0.5～30 kV、ビーム電流:30 nA (30 kV) 分解能:6 nm (30 kV)、加工形状:矩形、ライン、スポット	装置使用料:3,432円/時間 技 術 料:8,580円/時間